

主要特点

- 库伦型静电吸盘
- 支持双电极、多电极设计
- 适用于 10^{-5} Pa及以下超高真空环境
- 静电吸附力大
- 吸附面全局面型精度高
- 吸附面表面图形可定制
- 适用于无磁环境

性能简介

静电吸盘(ESC)是半导体工艺中的硅片夹持工具。ESC以静电吸附为基本原理在施加外部高压后,通过静电吸盘对硅片的库仑吸附力或J-R吸附力来固定硅片的。

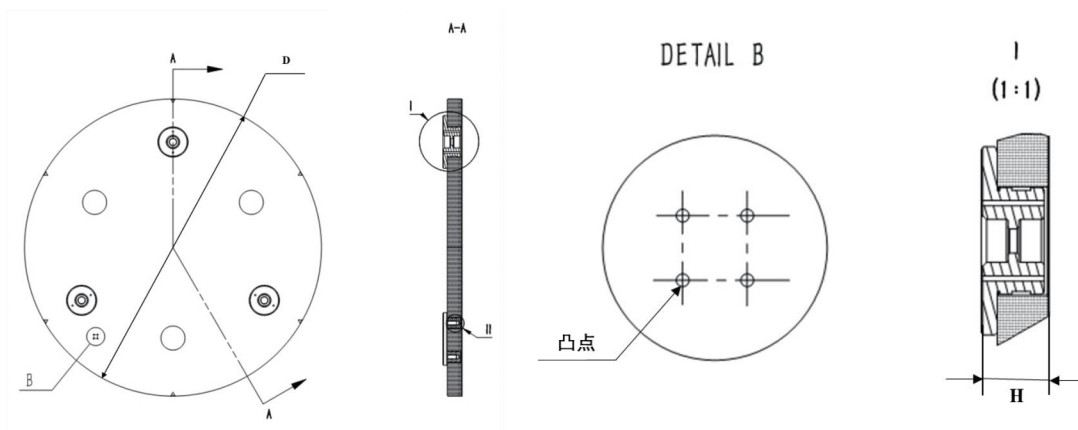
选择隐冠的原因

1. ESC和定制控制器由单一供应商提供,确保系统性能良好。
2. 最小化脱夹时间,提高ESC操作效果。
3. 在晶圆加工过程中保持均匀和恒定的夹紧力。

主要应用

- 电子束检测
- CD-SEM
- 键合
- Review-SEM

机械尺寸图



通用外形尺寸,单位:mm

技术参数

| | 6inch ESC | 8inch ESC | 12inch ESC | 单位 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|------------|----|
| 原理类型/Electrostatic type | 库伦型 | 库伦型 | 库伦型 | |
| 电极数量/Number of electrodes | 双电极 | 双电极 | 双电极 | |
| 精度/Accuracy | | | | |
| 全局平面度/Global flatness | <1 | <1 | <2 | μm |
| 平行度/Parallelism | <5 | <5 | <5 | μm |
| 电气性能/Electrical properties | | | | |
| 标准吸附电压/Standard clamping voltage | 1000 | 1000 | 1000 | V |
| 漏电流/Leakage current | <5 | <5 | <5 | nA |
| 性能参数/Performance parameter | | | | |
| 吸附力/Clamping force | ≥10 | ≥16 | ≥40 | N |
| 外观尺寸/Dimensions | | | | |
| 直径/Diameter | 144 | 194 | 294 | mm |
| 厚度/Thickness | 12.6 | 12.6 | 12.6 | mm |

*电极数量、平面度指标、外形尺寸和相关结构均可定制化设计